

p. 95

誤：

古島 弥来	応 用 化 学	三次元 shave-off 法の開発	教 授 尾張 眞則
荒川 靖章		スパッタリング成長不純物添加 GaN の評価に関する研究	教 授 藤岡 洋

正：

荒川 靖章	応 用 化 学	スパッタリング成長不純物添加 GaN の評価に関する研究	教 授 藤岡 洋
-------	---------	------------------------------	----------

p. 102

誤：

平井悠太郎		アトムプローブ顕微鏡を用いた有機試料の測定に関する研究	教 授 尾張 眞則
篠塚 正之		Si (111) 基板上への GaN 薄膜成長に関する研究	教 授 藤岡 洋

正：

平井悠太郎		アトムプローブ顕微鏡を用いた有機試料の測定に関する研究	教 授 尾張 眞則
古島 弥来		三次元 shave-off 法の開発	教 授 尾張 眞則
篠塚 正之		Si (111) 基板上への GaN 薄膜成長に関する研究	教 授 藤岡 洋